文章编号: 1001 3806(2003) 04 0293 03

基于激光频率分裂的波片位相差测量方法*

宗晓斌 朱 钧 李 岩 张 毅 张书练 (清华大学精密仪器系精密测试技术与仪器国家重点实验室,北京,100084)

摘要: 应用激光频率分裂技术可以测量波片的位相延迟。将波片插入到激光谐振腔内,使激光纵模产生分 裂,分别探测由同级和不同级分裂纵模产生的相邻两个频差,就可以求得波片的位相延迟。这种方法只需测量频 差而不依赖于任何机械量的测量,并可以将位相延迟的测量溯源到激光的波长上。实验表明,该系统的测量分辨 率可达 0.003,多次重复测量的偏差在 0.05°以下,系统不确定度对于厚度 1.5mm 的石英晶体 1/4 波片约为 ĺ。

关键词: 激光:波片:位相差:频率分裂 中图分类号: TN247 文献标识码: A

Phase retardation measurement of wave plate based on laser frequency splitting technology

Zong Xiaobin, Zhu Jun, Li Yan, Zhang Yi, Zhang Shulian (State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instrument, Dapartment of Precision Instrument, Tsinghua University, Beijing, 100084)

Abstract: Laser frequency splitting technology can be used to measure phase retardation of a wave plate. With the wave plate inserted into a laser cavity to split longitudinal laser, its phase retardation can be calculated by detecting the frequency differences between the same order or the adjacent order split longitudinal modes. No mechanical parameters but only the frequencies of optical beats need to be measured, and the measurement can be traced to the wavelength of the laser. Experiments prove that a resolution of 0.003° and a repeatability of 0.05° can be ensured. For a quartz quarter wave plate of 1.5mm thick, the incertitude of the system is about 1.

Key words: laser; wave plate; phase retardation; frequency splitting

引 言

波片在光学领域内有着广泛的应用,它不仅是 光学系统的重要组成元件,而且其自身位相延迟量 的精度会直接影响到整个系统的效果或测量精度, 因此,精确测量波片的位相延迟非常重要。目前,常 用的高精度波片测量方法(以测量 1/4 波片为主)有 旋转消光法,电光调制法^[1],旋转检偏器法,椭偏 仪,偏振干涉术^[2],光学外差干涉术^[3],磁光调制法 等。这些测量方法的原理及技术已较成熟.但是其 设备调整较复杂,如绝大部分方法需要精确测量角 度,而高精度的测角仪体积很大,成本较高。这些方 法的测量环节引入了较多的仪器误差和方位调整误

收稿日期: 2002-07-12; 收到修改稿日期: 2002-09-19

差, 使测量精度难以进一步提高。此外, 这些方法多 以角度等机械量作为被测量,难以作为测量位相延 迟的基准方法。

文中阐述了一种应用激光频率分裂技术^[4]的 波片测量方法,可以测量检定标准的 1/4 波片和其 它类型的波片。更重要的是,该方法将位相延迟的 测量溯源到激光的波长上,因此,有可能作为位相延 迟测量的基准方法。

理 1 原

通过腔内双折射效应可以使激光纵模发生分 裂。在激光谐振腔内插入一个双折射元件, 例如石 英晶体,由于其双折射效应,原本单一频率的激光将 分裂成为振动方向互相垂直、频率不同的两种光,即 o光(寻常光)与e光(非常光)。由文献[4]知,二者 频率差的绝对值为: $\Delta \mathcal{V} = \mathcal{V} \partial \mathcal{V} L$ (1) $\frac{\Delta V}{\Delta} = \frac{\delta}{\lambda/2}$ 相对频率分裂量: (2)

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All House All House

^{*} 国家自然科学基金资助项目。

作者简介: 宗晓斌, 男, 1978 年 6 月出生。博士研究 生。现从事 He Ne 激光及其测量方面的应用研究。

件造成的 o 光与 e 光之间的光程差, \triangle 为激光器纵 模间隔。

对于波片,其位相差: $\varphi = 2\pi \delta \lambda$ (3) 故由(2)式,(3)式可得: $\varphi = \Delta V \pi / \Delta$ (4) 如果使用 1/4波片,其位相差为 $\varphi = \pi / 2$,代入(4)式 得 $\Delta V = \Delta / 2$,即 1/4 波片引起频率分裂造成的频差 是激光纵模间隔的一半。

由(2)式、(4)式可见,如果能测出两频率的频差 Δν和纵模间隔 Δ,即可得到其光程差 δ与位相差 φ。因此,可以将待测波片作为双折射元件放入激 光腔内,通过测量频差来得到其光程差和位相差。

要求得 φ , 必须先测出 Δv 和 Δ 。在激光腔内放 入波片后, 每一个纵模都分裂为两个, 用扫描干涉仪 及示波器观察, 可看到如图 1 实线所示一系列 o 光 和 e 光相间的频率。如果取其中任意 3 个连续的频 率作为观察对象, 相邻的两个频率必为 1 个 o 光, 1 个 e 光, 相间的 两个频率必同为 o 光或同是 e 光。 由同一纵模如 v_i 分裂的两频率 v'_i 和 v''_i 的间隔就是 Δv , 而相间两频率 v'_q 和 v_{q+1} 的间隔为 Δ 。通过调 节损耗和改变腔长等手段, 可以让激光器只输出纵 模 v'_q 和 v''_q , 取它们的拍频并用频率计测量, 可以得 到 Δv_o



Fig. 1 Shift of longitudinal modes on frequency axis

由于无法准确测定腔长, \triangle 很难直接测量。注 意到相邻两个纵模形成的频差可以是| $v'_q - v''_q$ |, 也 可以是由纵模 v_{q+1} 和 v''_q 形成的拍频| $v_{q+1} - v''_q$ |, 也 而且有| $v'_q - v''_q$ |+ | $v_{q+1} - v''_q$ |= | $v_{q+1} - v'_q$ |= \triangle 。如果分别测量了 $\triangle v = |v'_q - v''_q|$ 和 $\triangle v =$ | $v'_{q+1} - v''_q$ |,则可以得到 $\triangle = \triangle v + \triangle v'$, 于是:

$$\varphi = \frac{\Delta \mathcal{V}}{\Delta \mathcal{V} + \Delta \dot{\mathcal{V}}} \pi \tag{5}$$

如果用角度来表示位相差,则:

$$\Psi = \frac{\Delta \mathcal{V}}{\Delta \mathcal{V} + \Delta \dot{\mathcal{V}}} \times 180^{\circ} \tag{6}$$

由上式可以看出,波片位相差只与两次测量的频差 值有关,而与腔长,纵模间隔和激光器的其它参数无 关。只要得到这两个频差值,就可以计算出波片位 相差。

调整激光器的增损比使得只有相邻的两个纵模 能够振荡出光。当腔长变化时,激光频率会改变,即 激光纵模会在频率轴上移动,移动的方向取决于腔 长是增大还是缩小,如图 1 所示(虚线表示移动后的 纵模)。先测得纵模 V'_q 和 V''_q 产生的频差 ΔV , 然后 调节腔长, 使纵模在频率轴上发生移动直到纵模 V_{q+1} 和 V''_q 出光,测得频差 ΔV , 由(5)式或(6)式即 可得到波片的位相差 φ 。

对于多级波片, 位相差 $\varphi_n = n(2\pi) + \varphi_0$, 则引 起的相应频差为 $\Delta V = 2n \Delta + (\varphi_0/\pi) \Delta_o$ 在实际测 量中, 纵模间隔 Δ 的整数倍没有任何作用, 测量得 到的相邻两个纵模间的频差是(φ_0/π) Δ , 计算出的 结果是位相差的小数部分 φ_0 。因为在实际应用中, 位相差的整数部分通常没有任何实际意义, 所以, 对 于多级波片这种方法同样适用。

上述频差与波片位相差的关系没有考虑有源腔 对激光频率的影响。通过数值计算得到的两分裂模 的光强准稳态近似解和调谐曲线,表明频差调谐的 相对大小约为 10⁻³量级,而充双同位素 Ne 能有效 地减小模竞争的影响,使光强变化平稳并且在中心 频率处 o, e 光有稳定的等光强点,在等光强点附近 调谐量及调谐量的变化幅度都比较小(10⁻⁵量级)。 实验结果与理论计算结论相符。

这种波片位相延迟测量方法只需要测量频差, 而不依赖于任何机械量,特别是角度的测量;频差对 于波片位相差变化的灵敏度很高(纵模间隔为 600MHz 时,波片位相差变化 1°,频差会变化 3.3MHz);频差的测量不易受到后续处理环节中的 干扰。故这种方法能达到很高的精度和分辨率。如 果频差能分辨到 1kHz,相应的位相差分辨率约为 1[″]。这种方法对任意位相差的波片都可以进行测 量,而不仅适用于 1/4 波片。从理论上说,对于其它 类型的位相延迟器,如菲涅耳棱镜、巴比涅补偿器、 电光调制器等都可以进行测量。

该方法的另一优点在于其可溯源性。在国际单 位制中,对于波片位相延迟的测量没有规定一个基 准的方法,但长度单位米的定义可以通过光在真空 中的波长来复现。对于波片的位相延迟,如果能将 测量方法溯源到光波长或者频率的标准,也可称其 具有可溯源性。在该方法中,由(2)式可知,波片位 相延迟的等同量——光程差δ仅与相对频率分裂 量ΔV Δ和波长λ有关,故光程差(位相差)的测量可 以溯源到激光波长,即这种测量方法具有可溯源性。

2 系统及实验

基于频率分裂原理的波片位相差测量系统如图 2所示。



Fig. 2 Experimental setup

系统中使用的激光器为 632.8nm 波长半内腔 He Ne 激光器,反射镜 M₁和 M₂构成激光谐振腔。 M₁为球面输出镜,固定在激光增益管 T 上,平面高 反镜 M₂固定在压电陶瓷 PZT 上。波片通过装夹装 置 FS 插入激光腔中,并使波片光轴垂直对准光束。 测量用波片均为石英晶体制成,并镀有增透膜。

经 M₁ 的出射光由分束镜 BS 分为两束,其中一 束经检偏器 P₂ 进入 F-P 扫描干涉仪 SI 以观察模 式,另外一束光经过方向与波片快轴成 45° 的检偏 器 P₁,两偏振分量间形成光拍,拍频等于二者的频 差。光拍由雪崩二极管 APD 接收转换成电信号,由 频率计 FC 测出其频率并输入计算机。渥拉斯顿棱 镜 W 将从 M₂ 透射的尾光中两种不同偏振态的光 分开,分别由光电探测器 D1 和 D2 接收。D1 和 D2 接收到的光强信号也同时输入计算机,在两光束的 等光强点计算机接收频率计送来的频差数值。计算 机通过 D/A 转换及高压放大器控制压电陶瓷 PZT, 带动其上的反射镜移动从而连续改变激光器腔长, 使纵模在频率轴上移动以选择由哪两个纵模出光并 形成拍频。测得连续两次的拍频信号后,即可根据 (6) 式求得波片位相差。 果见表 1。这 3 个波片均为石英晶体制成,厚 1.5mm。原标称值是采用电光调制法测量得到的, 分别为:(a) 93°;(b) 89°;(c) 30°,精度约为 0.5°~1°。

3 个波片测量的标准差分别为 0.01^{6°}(0.9^{6′}), 0.023[°](1.4′)和 0.020[°](1.2′),经过温度补偿后的 测量结果分别为 93.132[°](20℃),89.968[°](20℃)和 30.330[°](20℃)。

Table 1 Measurement result of 3 samples

a measured at 21.15 C					
	$\Delta \mathcal{V} / \operatorname{M} \operatorname{Hz}$	$\Delta v'$ / M Hz	ዋ/ (°)		
1	418.536	399.452	92.100		
2	418.468	399.322	92.107		
3	418.625	399. 368	92.118		
4	418.807	399.319	92.144		
5	418.652	399. 496	92.107		
6	418.430	399. 315	92.104		
average	418.586	399. 379	92.113		

b—measured at 20.86°C				
	$\Delta \mathcal{V} / \operatorname{M} \operatorname{Hz}$	$\Delta v'$ / M Hz	𝒫(°)	
1	405.175	412.657	89.177	
2	405.342	412.683	89.192	
3	405.568	412. 492	89. 238	
4	405.439	412.837	89.186	
5	405.265	412.768	89.175	
6	405.381	412.783	89.186	
average	405.362	412.703	89. 192	

c —m easured at 20.89°C				
	$\Delta \mathcal{V} / \operatorname{M} \operatorname{Hz}$	$\Delta v'$ / M H z	Ψ/ (°)	
1	139. 751	711.322	29.557	
2	139.664	711.480	29.536	
3	139. 626	711.515	29. 528	
4	139. 639	711.536	29.530	
5	139. 492	711. 554	29.503	
6	139. 553	711.763	29.507	
average	139.6208	711. 5283	29. 527	

3 结束语

激光频率分裂技术可以应用于波片位相延迟的 测量。应用这种测量方法的系统结构简单,调整方 便,只需测量频差,而无需高精度测角仪和复杂的机 (下转第306页)

◎ **对两个**3/4 波片和一个约 30[°]位相片的测量结

同时, 还测到了这些介质在不同聚焦深度(*L* = 9cm, 4cm 和 0cm) 下所产生的 SBS 波形。图 2 给出 了一些介质在 *L* = 4cm 时所产生的 SBS 波形。从 波形中可看出: 在相同条件下, 吸收系数大的介质所 产生的 SBS 波形比吸收系数小的介质所产生的 SBS 波形前沿陡。



Fig. 2 The SBS pulse shapes produced in different liquids for L = 4 cma-CC I₄ b-benzene c-methyl alcohol

3 分析和讨论

介质的吸收系数、增益系数、声子寿命和折射率 等都影响介质所产生的 SBS 性能, 但是聚焦深度较 浅时, 不同介质吸收系数的差异是它们所产生的 SBS 性能有差异的主要因素。从表 1 中可看出: 从 上而下介质的吸收系数逐步增大, 这种变化导致了 介质所产生的 SBS 性能的变化。这是因为对于吸 收系数小的介质来说, 介质对泵浦光和 Stokes 光的 吸收较小、焦点附近的泵浦能量较高, SBS 产生时间 提前, Stokes 脉冲前沿放大较小, 因此, 它们所产生 的 SBS 脉宽较宽、能量较高和波形前沿不是很 陡^[6]。而对于吸收系数较大的介质来说, 介质对泵 浦光和Stokes光的吸收较大、焦点附近的泵浦能量

(上接第295页)

械结构,并具有可溯源性。实验表明,该系统的测量 分辨率可达 0.003°,多次重复测量的偏差在 0.05° 以下,系统不确定度对于厚度 1.5mm 的石英晶体波 片约为 1。

曲阜师范大学提供了测试所需的波片,在此谨 表示感谢。 较低, SBS 产生时间较晚, Stokes 脉冲前沿放大较 大,故它们所产生的 SBS 脉宽较窄、能量较低和波 形前沿很陡。另外,对每种介质来说所产生的 SBS 脉宽和能量均随着聚焦深度的增大而变小,这是因 为聚焦深度越大,泵浦光与 Stokes 光的相互作用长 度增加, Stokes 光的前沿放大增强, SBS 脉宽变窄。 但是由于随着聚焦深度的增加,介质对泵浦光和 Stokes 光的吸收也增加,导致了 Stokes 光的能量的 降低。甚至导致一些吸收系数较大的介质(如乙醇、 甲醇和水等)的焦点附近的泵浦光达不到 SBS 阈 值。

从实验结果还可以看出,选择 SBS 液体介质时 不仅考虑 SBS 参数(如 g 和 T 等)还必须考虑它们 的吸收系数。有些 SBS 液体介质虽然有理想的 SBS 参数,但是它们的吸收系数较大,对泵浦光和 Stokes 光的吸收很强,因此,在实际应用当中受到限制。

参考文献

- [1] Dan e C B, Neuman W A, Hackel L A. IEEE J Q E, 1994, 30(8): 1907~1915.
- [2] 杨爱铃,杨经国.激光杂志,1998,19(4):13~17.
- [3] 葛传文,张为俊,王 沛 et al. 激光与光电子学进展, 2000, 412 (4):18~22.
- [4] 陈伯涛, 林平娣, 张启昆 et al. 无机化学. 3 版, 北京: 高等教育 出版社, 1992: 294~ 296.
- [5] 朱 丹,张鹏翔,周仲壁 et al. 物理学报, 1989, 38(4):683~ 688.
- [6] 刘 莉. 受激布里渊散射相位共轭镜的脉冲波形与控制问题. 哈尔滨工业大学工学博士学位论文, 2000: 109~110.

参考文献

- [1] Shyu L, Chen C, Su D. Appl Opt, 1993, 32(22): 4228~ 4230.
- [2] Sankarasubramanian K, Venkatakrishnan P. Opt & Laser Technol, 1998, 30(1): 15~ 21.
- [3] Lin Y, Zhou Z, Wang R. Opt Lett, 1988, 13(7): 553~ 555.
- [4] Zhang S, Guo H, Li K et al. Opt & Laser in Engng, 1995, 23(1):
 1~ 28.